Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-183525

(43)Date of publication of application: 02.07.2004

(51)Int.Cl.

F01N 3/02 B01D 53/94 F01N 3/18 F01N 3/24 F01N 3/36 F02D 41/04 F02D 43/00 F02D 45/00 // B01D 46/42

(21)Application number: 2002-349668

(71)Applicant: NISSAN MOTOR CO LTD

(22)Date of filing:

02.12.2002

(72)Inventor: KONDO MITSUNORI

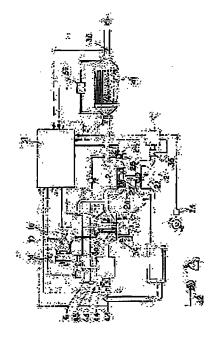
KAWASHIMA JUNICHI TSUTSUMOTO NAOYA OTAKE MAKOTO TABATA MUNEHIRO

(54) EXHAUST EMISSION CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To satisfy three requirements of regeneration treatment by using regeneration treatment of three stages.

SOLUTION: In this exhaust emission control device, a filter 41 for collecting particulates is provided to an exhaust passage 2, and the regeneration treatment of the filter 41 is performed at a regeneration time. The device has regeneration treatment means 31, 10, and 42 for performing two post injections and two oxygen concentration controls per one cycle of an engine so as to obtain a constant target regeneration speed during the regeneration treatment of the filter 41.



(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開2004-183525 (P2004-183525A)

(43) 公開日 平成16年7月2日(2004.7.2)

| | | | | (20) 51125 | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------------------|--|--|---------|
| (51) Int.C1.7 | | FI | | | テーマコー | (参考) |
| FO1N | 3/02 | FO1N | 3/02 | 321B | 3G084 | |
| BO1D | 53/94 | FO1N | 3/02 | 321A | 3G090 | |
| FO1N | 3/18 | FOIN | 3/18 | В | 3G091 | |
| FO1N | 3/24 | FOIN | 3/24 | E | 3G3O1 | |
| FO1N | 3/36 | FOIN | 3/24 | R | 4D048 | • |
| FUIN | 3/30 | 審査請求 オ | | 項の数 8 O L | (全 26 頁) | 最終頁に続く |
| (21) 出願番号 (22) 出願日 | | 特願2002-349668 (P2002-349668) 平成14年12月2日 (2002.12.2) | (71) 出願人 (74) 代理人 (74) 代理人 | 日産自動車株: 神奈川県横浜 100075513 弁理士 後藤 | 市神奈川区宝町 | 2番地 |
| | | | (72) 発明者 | 神奈川県横浜 | 近藤 光徳 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産 自動車株式会社内 | |
| ٠. | | · | (72) 発明者 | | 市神奈川区宝町 社内 | 2.各地 日産 |

最終頁に続く

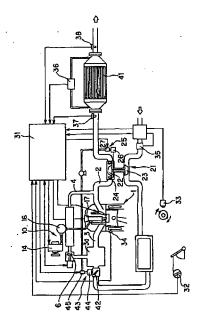
(54) 【発明の名称】排気浄化装置

(57)【要約】

【課題】 3 段階の再生処理によって再生処理の 3 つの要求を共に満たす。

【解決手段】排気通路(2)にパティキュレートを捕集するフィルタ(41)を備え、フィルタ(41)の再生時期になるとフィルタ(41)の再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において、フィルタ(41)の再生処理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンジンの1サイクル当り回のポスト噴射と酸素濃度制御とを行う再生処理手段(31、10、42)を備える。

【選択図】 図1



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

排気通路にパティキュレートを捕集するフィルタを備え、

フィルタの再生時期になるとフィルタの再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において

、 フィルタの再生処理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンジンの1サイクル当り 2回のポスト噴射と排気の酸素濃度制御とを行う再生処理手段を備えたことを特徴とする 排気浄化装置。

【請求項2】

前記フィルタの再生処理期間を前期、中期、後期から構成し、

前期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ペッド温度へと制御する昇 温制御を行い、

中期に再生速度が目標再生速度へと小さくなるように第1目標ペッド温度を維持させる第 1目標ペッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制 御を行い、

後期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ペット温度より高い第2目標ペット温度を維持させる第2目標ペット温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃度に設定した第2酸素濃度制御を行う

ことを特徴とする請求項1に記載の排気浄化装置。

【請求項3】

前記中期における第1目標ペッド温度を維持させる第1目標ペッド維持制御を、1サイクル当り抹気温度上昇用の1回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項2に記載の排気 浄化装置。

【請求項4】

前記後期における第2目標ペッド温度を維持させる第2目標ペッド維持制御を、1サイクル当り排気温度上昇用とHC供給用の2回のポスト順射で行うことを特徴とする請求項2に記載の排気浄化装置。

【請求項5】

前記フィルタに触媒を担持している場合に、前期は、触媒活性温度へと制御する昇温制御を行う前段と、第1目標ペッド温度へと制御する昇温制御を行う後段とからなることを特徴とする請求項2に記載の排気浄化装置。

【請求項6】

前記前段における触媒活性温度へと制御する昇温制御を、1サイクル当り排気温度上昇用の1回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項5に記載の排気浄化装置。

【請求項7】

前記後段における第1目標ペッド温度へと制御する昇温制御を、1サイクル当り排気温度 上昇用とHC供給用の2回のポスト噴射で行うことを特徴とする請求項5に記載の排気浄 化装置。

【請求項8】

前記HC供給用のポスト噴射を実行する際に目標値に対して応答遅れ処理を施した値とす 4 ることを特徴とする請求項7に記載の排気浄化装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明はディーゼルエンジンの排気パティキュレートを処理する排気浄化装置に関する。 【0002】

【従来の技術】

ディーゼルエンジンから排出される排気パティキュレートを処理する左めに、 排気系にパティキュレートを捕集するフィルタを配置し、 フィルタに所定量のパティキュレートが堆積したとき、フィルタ温度を上昇させてフィルタに堆積しているパテキュレートを燃焼処

10

20

80

20

30 .

JP 2004 183525 A 2004.7.2

(3)

理する、いわやるフィルタの再生処理を行うものが各種提案されている(特許文献1参照)。

[0008]

【特許文献1】

特開平7-259583号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、フィルタの再生処理には概ね次の3つの要求を共に満たさなければならない。 【0005】

(1) 再生処理の開始に際しては、フィルタのペッド温度を、フィルタに堆積しているパティキュレートの自着火温度まで速やかに上昇させる必要がある。フィルタのペッドを昇温させるため例えばポスト噴射や燃料噴射時期の遅角が行われるが、速やかな昇温が要求されるのは、フィルタのペッド昇温期間が長引けばそれだけ燃費が惡化するがらである。 【0006】

(2)フィルタのベッド温度がパティキュレートの自着火温度に達してパティキュレートが燃焼する段階になると、フィルタのベッド温度が許容最高温度を超えないようにパティキュレートの燃焼速度を抑制する必要がある。これは、パティキュレートの燃焼速度(フィルタの再生速度)が速いとフィルタに堆積している大量のパティキュレートが急激に燃焼してフィルタのベッド温度が許容最高温度を超え、これによってフィルタに熱劣化が生じて耐久性が低下しかねないからである。

[0007]

(3) 再生処理の終了間近に際しては、フィルタにパティキュレートの燃え残りが生じないようにする必要がある。これはフィルタに燃え残りが生じると、次のような問題点が生じるからである。

[0008]

▲1▼フィルタの圧力損失が完全になくならないので、燃費が惡化する。

[0009]

▲ 2 ▼燃え残り部分にパティキュレートが堆積すると堆積分布のアンパランスが生じ、次の再生処理時にその部分の急激燃焼によりフィルタの耐久性が低下する。

[0010]

やこで本発明はフィルタの再生処理中に一定の目標再生速度が得られるように1サイクル当り2回のポスト噴射と酸素濃度制御とを行うことにより、再生処理の上記3つの要求を共に満たす装置を提供することを目的とする。

[0011]

一方、上記の従来装置においては、触媒活性前に1サイクル当たり1回のポスト順射を行い、触媒活性後には1サイクル当たり2回のポスト喷射を行っている。

[0012]

しかしながら、従来装置は上記(1)の要求、つまりフィルタのペッド温度を上昇させようとするものでしかないので、上記(2)の要求に応じることができない。すなわちないタのペッド温度がパティキュレートの自着火温度に達するとパティキュレートが急上昇する。この段階でも、従来装置のように出外のペッド温度が急上昇する。この段階でも、超えてして1サイル当時では、再生速度が目標を超えてして、本願発明を超えて上昇しかなない。これに対して、本願発明ではは、1サイクル当り1回のポスト・は、1サイクル当り1回のポスト・は、1サイクル当り1回のポスト・は、1サイクル当り1回のポスト・は、1サイクル当り8回のポスト・は次年には、1サイクル当り8回のポスト・はを変更に設定した第1酸素濃度を超えて、再生速度が1とで、表濃度を超えて大きくならないようにするのであり、このように触媒をでは表現を上昇するな来装置と、フィルタの再生速度に着目する本願発明とでは技術的思想が異なっている。

(4)

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明は、排気通路にパティキュレートを捕集するフィルタを構え、フィルタの再生時期 になるとフィルタの再生処理を行うエンジンの排気浄化装置において、フィルタの再生処 理中に一定の目標再生速度が得られるようにエンデンの1サイクル当り2回のポスト噴射 と排気の酸素濃度制御とを行う再生処理手段を備えている。具体的にはフィルタの再生処 理期間を前期、中期、後期から構成し、前期に再生速度が目標再生速度へと大きくなるよ うに第1目標ペッド温度へと制御する昇温制御を行い、中期に再生速度が目標再生速度へ と小さくなるように第1目標ペッド温度を維持させる第1目標ペッド温度維持制御及び排 気中の目標酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制御を行い、後期に再生速度が目標 再生速度へと大きくなるように第1目標ペッド温度より高い第2目標ペッド温度を維持さ せる第2目標ペッド温度維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃度に設定した第2酸素 濃度制御を行う。

[0014]

【発明の効果】

本発明による再生処理手段によれば、次の効果が得られる。

[0015]

(1) 前期にはフィルタのペッド温度をパティキュレートが自着火する温度である第1目 様ペッド温度にまで急速に上昇させることができる。

20

[0016]

(2)中期にはフィルタのペッド温度がパティキュレートが自着火する温度である第1目 標ペッド温度に維持した状態で第1酸素濃度制御が行われるが、この第1酸素濃度制御に よれはフィルタに堆積している大量のパティキュレートが急激に燃えることがなりように 排気中の目標酸素濃度を低濃度の酸素濃度に設定してあるので、フィルタのペッド温度が 許容最高温度を上回ることがなく、これによりフィルタの耐久性が損なわれることがない

[0017]

なお、排気温度を低下させることによりパティキュレートの燃焼速度を抑制する方法もあ るが、この排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、排気やフィルタの熱 慣性の影響を受けて制御の応答性が惡く、パティキュレートが急激に燃えることが困難で 、制御性が劣る。これに対して本発明では、こうした排気温度によるパティキュレート燃 焼速度制御方法でないため、排気やフィルタの熱慣性の影響を排除でき、制御応答性がよ く制御の信頼性が高い。

[0018]

(3)後期には第1目標ペッド温度よりも高い第2目標ペッド温度に維持した状態で目標 酸緊濃度を第1酸緊濃度制御時より大きくして十分な酸素を供給することで、再生処理の 終了間近にフィルタに残存するパティキュレートを迅速にかつ確実に燃え切らせることが できる.

[0019]

このように、本発明では、再生処理の前期、中期、後期に要求されるところを総て満たす ことから、再生処理期間を短縮できると共に、ほぼ完全なフィルタ再生を図ることができ 7.

[0020]

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を図面に基づりて説明する。

[0021]

図1は本発明の一実施形態を示す概略構成図である。

[0022]

図1において、1はディーセルエンジンで、排気通路2と吸気通路3のコレタタ部3瓜と を結ぶEGR通路4に、圧力制御弁(図示しない)からの制御圧力に施動するダイヤフラ

(5)

ム式のEGR弁6を備えている。圧力制御弁は、エンプンコントローラ81からのデューティ制御信号により駆動されるもので、これによって運転条件に応じた所定のEGR率を得るようにしている。

[0023]

エンデンにはコモンレール式の燃料噴射装置10を構える。この燃料噴射装置10は、主に燃料タンク(図示しない)、サプライボンプ14、コモンレール(蓄圧室)16、気筒毎に設けられるノズル17からなり、サプライボンプ14により加圧された燃料は蓄圧室16にいったん蓄えられ、蓄圧室16の高圧燃料が気筒数分のノズル17へと分配される

[0024]

ノズル17(燃料噴射弁)は、針弁、ノズル室、ノズル室への燃料供給通路、リテーナ、油圧でストン、リターンスプリングなどからなり、油圧でストンへの燃料供給通路に三方弁(図示しない)が介装されている。三方弁(電磁弁)のOFF時には、針弁が着座状態にあるが、三方弁がON状態になると針弁が上昇してノズル先端の噴孔より燃料が噴射される。つまり三方弁のOFFがらONへの切換時期により燃料の噴射開始時期が、またON時間により燃料噴射量が調整され、蓄圧室18の圧力が同じであればON時間が長くなるほど燃料噴射量が多くなる。

[0025]

EGR通路4の開口部下流の排気通路2に、排気の熱エネルギーを回転エネルギーに変換するターピン22と吸気を圧縮するコンプレッサ23とを同軸で連結した可変容量ターボ過給機21を備える。ターピン22のスクロール入口に、アクチュエータ25により駆動される可変ノズル24が設けられ、エンジンコントローラ31により、可変ノズル24は色回転速度域から所定の過給圧が得られるように、色回転速度側ではターピン22に導入される排気の流速を高めるノズル開度(傾動状態)に、高回転速度側では排気を抵抗なくターピン22に導入させノズル開度(全扇状態)に制御する。

[0026]

上記のアクチュエータ25は、制御圧力に応動して可変ノズル26を駆動するダイヤフラムアクチュエータ26と、このダイヤフラムアクチュエータ26への制御圧力を調整する 圧力制御弁27とからなり、可変ノズル24の実開度が目標ノズル開度となるように、デューティ制御信号が作られ、このデューティ制御信号が圧力制御弁27に出力される。

[0027]

アクセルセンサ 3 2、エンジン回転速度とクランク角度を検出するセンサ 3 3、水温センサ 3 4、エアフローメータ 3 5 からの信号が入力されるエンジンコントローラ 3 1 では、これらの信号に基づいて目標EGR率と目標過給圧とが得られるようにEGR制御と過給圧制御を協調して行う。

[0028]

排気通路 2 には排気中のパティキュレートを捕集するフィルタ4 1 が設置される。このフィルタ4 1 には酸化触媒が担持されており、フィルタ4 1 のパティキュレートの堆積量が 所定値に達すると、排気温度を上昇させてフィルタ4 1 に堆積しているパティキュレート を燃焼除去する。

[0029]

フィルタ41の圧力損失(フィルタ41の上流と下流の圧力差)を検出するために、フィルタ41をパイパスする差圧検出通路に差圧センサ36が設けられる。

[0030]

この差圧センサ 3 6 により 検出されるフィル 9 4 1 の圧力損失 Δ P は、 温度センサ 3 7 か らのフィル 9 入口温度 T 1、 温度センサ 3 8 からのフィル 9 出口温度 T 2 8 共にエンデンコントローラ 3 1 では、 主にマイクロプロセッサで構成されるエンデンコントローラ 3 1 では、 これらに基づいてフィル 9 4 1 の再生処理を行う。 すなわち、 フィル 9 4 1 の再生処理の期間を時系列的に図 2 に示したように前期(t 1 の時間)、 中期(t 2 の時間)、 後期(t 3 の時間)の 3 つの期間に分割するものの、 再生処理の全区間を通して一定

= 0

(6)

の目標再生速度が得られるように 1 サイクル当り機能の異なる 2 回のポスト 噴射と酸素濃度制御とを行う。

[0081]

これをさらに図る、図4を参照しながら説明する。図るにおいて第4段目に本実施形態によるポスト噴射の特性を、また最下段に本実施形態による排気中の目標酸紊濃度の特性を示す。

[0032]

ここでは機能の異なるポスト噴射を導入している(図4上段参照)。すなわち、ポスト噴射1は、シリング内で燃焼させて直接的に排気温度の上昇を図ることを目的として、メイン噴射に近い噴射時期(TDC~ATDC60de分)に設定する。これに対して、ポスト噴射2は、フィルタ41に担持している酸化触媒にHCを供給し、その触媒反応でHCを燃焼させてフィルタ41のペット温度を上昇させることを目的として、シリング内でほとんど燃焼しない時期(ATDC60de分以降)に設定する。

10

[0033]

く1 〉 前期:

フィルタ41のペッド温度が触媒活性温度(およそ240℃)以下にある前段では、早期に触媒を活性化させるためにポスト噴射1を実行する(図4下段の左参照)。このとき、 触媒ではHCの反応が行われないのでポスト噴射2は行わない。

[0034]

フィルタ41のペッド温度が触燥活性温度を超える後段になると、ポスト噴射1に加えてポスト噴射2を実行し、ペッド温度をさらに上昇させる。フィルタ41のペッド温度が上昇して第1目標ペッド温度(600℃程度)セTbed1に到達すると、前期を終了して次の段階の中期に移行する。

20

[0035]

ここで、前段より後段への移行は、フィルタ41の実ペッド温度とTbe むが触媒活性温度に達したが否がにより行う。フィルタ41の実ペッド温度はフィルタ41前後に設けている温度センサ37、38からの信号に基づいて推定する。

[0086]

ただし、前期の時間内では排気中の目標酸素濃度は定めず、従って酸素濃度制御は行わない。

30

[0087]

(2) 中期:

フィルタ41に堆積しているパティキュレートの燃焼速度(フィルタの再生速度)を抑制するため、排気中の目標酸素濃度を図る最下段に示したように低濃度に設定し、この低濃度の目標酸素濃度が得られるように酸素濃度制御(第1酸素濃度制御)を行う。

[0038]

また、フィルタ41の実ペッド温度が第1目標ペッド温度 t T b e d 1 と一致するようにポスト噴射1のポスト噴射量をフィードバック制御する(図4下段の中参照)。フィルタ41内のパティキュレートが活発に燃焼して、第1目標ペッド温度が維持される場合にはポスト噴射1を行わない。

40

[0039]

低濃度に設定した目標酸繁濃度が得られるように排気中の酸素濃度制御を行うと共に第1目標ペッド温度を維持する温度制御を行うことで、フィルタ41に堆積したパティキュレートが急激に燃焼することなく燃焼が進行する。

[0040]

く3) 後期:

再生処理の終了間近にフィルタ41に残存するパティキュレートをもれなく燃やし切るため、排気中の目標酸素濃度を図る最下段のように中期の場合より高濃度に設定し、この高濃度の目標酸素濃度が得られるように酸素濃度制御(第2酸素濃度制御)を行う。

[0041]

20

(7)

また、後期にはポスト噴射1に加えてポスト噴射2を行い、フィルタ41の実ペッド温度 が、第1目標ペッド温度セTbed1よりも高い第2目標ペッド温度セTbed2(65 0℃程度)と一致するようにポスト噴射2のポスト噴射量をフィードバック制御する(図 4下段の右参照)。

[0042]

このように高濃度に設定した目標酸素濃度が得られるように排気中の酸素濃度制御を行うと共に中期よりも高い第2目標ペッド温度を維持する制御を行うことで、再生効率が高まり、完全再生である100%へと近づいていく。

[0048]

こうした考え方の元になったものは、次の通りである。すなわち、排気温度を一定に保ったとき、フィルタに堆積されているパティキュレートは再生処理の開始により徐々に燃烧し始め、やがて塊となって活発に燃え、その後に下火になり、燃焼が終了する。この燃焼状態を表すのが再生速度である。このため再生速度は、図る最上段に実線で示したように、再生処理の開始より徐々に大きくなってじークを採り、その後に小さくなっている。こうした再生速度の変化に合わせるかのように、フィルタのペット温度が変化している(図る第2段目の破線参照)。

[0044]

ここで、図3最上段は、フィルタをひとかたまりとしてみたときの再生速度の時間的変化であるが、実際にはフィルタ内でのパティキュレートの堆積分布やガス流れ分布は一様でなく、空間的にも再生速度のムラが生じている。

[0045]

このように時間的あるいは空間的に再生速度に変化(ムラ)があると困るのはフィルタ41内にパティキュレートの燃え残りが生じることで、この燃え残りがあると、次回のはフィルタの燃え残りが生じることがあると、次回の水が、次回の水で、から、での分だけフィルタのベットを燃焼し、での分だけフィルタのベットを燃焼して、とかなく、が、例えばことが発力をした。とから、大きのかないが、例えばことで変からは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのである。となるようには、大きのである。となるようには、大きのである。となると、大きのであると、大きのである。となると、大きのであると、大きのである。と、大きのであると、大きのである。

[0046]

次に、エンジンコントローラ81により行われるこれら制御の内容を詳述する。

[0 0 4 7]

図5のフローチャートは再生処理を行うためのメインルーチンで、このフローは一定時間 毎(例えば10mS毎)に実行する。

[0048]

ステップ1では再生処理フラグをみる。この再生処理フラグの設定については、図6のフローにより説明する。

[0049]

図 6 のフローは図 5 とは別に一定時間毎(例えば10mS毎)に実行する。図 6 においてステップ 1 1ではフィルタ 4 1の圧力損失 Δ P を差圧センサ 3 6の出力がら読み込む。

[0050]

ステップ 1 2 では再生処理フラグをみる。再生処理フラグは後述する再生処理条件が成立したとき 1 となるフラグである。エンジン始動時にはゼロに初期設定されているので、再生処理条件の成立する前にはステップ 1 8、1 4 に進み、再生処理条件をみる。再生処理条件の成立は、フィルタ4 1 の圧力損失 Δ P が再生開始判定値 Δ P H M の × を超えかつ再生実施条件にあることである。

[0051]

50

(8)

ここで、再生実施条件は例えばエンジンの回転速度と燃料噴射量(エンジン負荷相当)により定まる運転条件がアイドル時やアイドルに近り低負荷域を除いた所定の領域にある場合に成立する。

[0052]

アイドル時やアイドルに近い低負荷域である領域で再生実施条件が非成立であるとするのは、アイドル時はもともと排気温度が低く、ポスト噴射及び吸気絞りを行ってもフィルタ41のペッド温度を第1目標ペッド温度 t T b e d 1 へと上昇させることができないからである。

[0058]

このため圧力損失 ΔP が再生開始判定値 ΔP H m ΔX 以下のときやエンジンの運転条件が 10 再生実施条件にないときにはそのまま今回の処理を終了する。

[0054]

フィルタ41の圧力損失 Δ P が再生 開始判定値 Δ P H m a × を超えかっエンジンの回転速度と燃料噴射量により定まる運転条件が再生実施条件にあるときには再生処理を行うことができると判断しステップ 1 5 に進んで再生処理フラグ= 1 とする。

[0055]

この再生処理フラグ=1により次回がらはステップ12よりステップ13へと進むことができないため、そのまま処理を終了する。

[0056]

図5に戻り、ステップ1で再生処理フラグ=1であるときには再生処理を行うためステッ 20プ2以降に進む。ステップ2では再生フェーズを設定する。この再生フェーズの設定については図7のフローにより説明する。

[0057]

図 7 の フロー (図 5 ステップ 2 のサプルーチン) は再生処理の開始 からの経過時間 T と設定時間 t 1、 t 2、 t 3 とを比較して、再生フェーズの前期、中期、後期を設定するためのものである。

[0058]

ステップ 2 1 では再生終了フラグをみる。再生終了フラグはゼロに初期設定されているので、ステップ 2 2 に進み、再生処理フラグをみる。再生処理フラグ= 0 のときはそのまま今回の処理を終了する。

[0059]

再生処理フラグ=1であるときにはステップ 2 3 に進み、タイマ値T(ゼロに初期設定) を、

 $T = T \times + \Delta T \qquad (1)$

ただし、 Δ T : 演算周期 (= 1 0 m S)、

Tz:タイマ値の前回値、

の式によりインクリメントする。このタイマは再生処理開始からの経過時間(つまり再生 処理時間)計測するためのものである。

[0060]

ステップ 24、25 ではこのタイマ値Tと設定時間七1、七2、七3(図2参照)とに基 40 プルマ、次のように再生フェーズの各期間を設定する。

[0061]

(1) T<t1であると♥:

ステップ24よリステップ26進み再生フェーズを前期に設定する。

[0062]

(2) t1≤T<t1+t2であるとき:

ステップ24よりステップ27に進み再生フェーズを中期に設定する。

[0063]

(8) t1+t2≤T<t1+t2+t8であるとき:

ステップ24、25よりステップ28に進み再生フェーズを後期に設定する。

50

[0064]

(4) t1+t2+t8≤Tであるとき:

このときには再生処理の終了であると判断し、ステップ24、25よりステップ29に進み再生終了フラグ=1とする。また、次回の再生処理に備えるためステップ30、31で再生処理フラグ=0かつタイマ値T=0とする。

(9)

[0065]

ステップ24で用いる上記の設定時間七1、七2、七8は一定値でもがまわないが、ここでは、七1と七2については次のように可変値で設定している。

[0066]

図8は再生処理開始時の実際のペッド温度に対する七1の設定例である。フィルタ41を再生するにはフィルタ41に堆積しているパティキュレートが自着火して燃焼し得る温度である第1目標ペッド温度七丁もed1にまで上昇させなければならないが、七1は再生処理の開始より第1目標ペッド温度せ下もed1に上昇させるまでの時間である。この時間七1は図8のように再生処理開始時のペッド温度が高くなるほど小さくなる。これは再生処理開始時のペッド温度が高ければフィルタ41のペッド温度を第1目標ペッド温度も丁もed1まで上昇させるに要する時間も短くて済むからである。

[0067]

また、七丁もed1以上の温度域では七1=0である。これは七丁もed1以上の温度域では昇温制御を行わなくともフィルタ41に堆積しているパティキュレートが自着火して燃焼するので、このときには七1をゼロとして次の段階の中期へと即座に移行させるためである。

[0068]

また、再生処理開始時のペッド温度が所定値Tのより低い温度域では一定値としている。 これは、Tのより低い温度域ではフィルタ41を昇温させようとしても目標ペッド温度セ Tbed1にまで昇温できないので、一定値としたものである。

[0069]

なお、図8において機軸の再生処理開始時の実際のペッド温度は、再生処理開始時にフィルタ41の前後に設けた温度センサ37、38により検出される2つの温度T1、T2から、

 $rTbed=b1 \cdot T1+b2 \cdot T2 \quad (2)$

ただし、Tbed:再生処理開始時のペッド温度、

b 1 、 b 2 : 定数、

の式により推定(算出)すればよい。(2)式のb1、b2は実験により決まる値である

[0070]

図9は再生処理開始時のパティキュレート堆積量(図ではPM堆積量で略記)に対する七2の設定例である。フィルタ41のペット温度を第1目標ペット温度もTbed1にまで上昇させた後は、フィルタ41に堆積しているパティキュレートが自着火して燃焼する。この場合に、排気中の酸素濃度が十分に大きい状態(空燃比でいうと理論空燃比よりリーン側の所定値A)ではフィルタ41に堆積している大量のパティキュレートが急激に放火をよってフィルタ41に熱劣化が生じて耐久性が低下しがねない。このため、フィルタ41に堆積している大量のパティキュレートが急激には燃えない程度の低い酸素濃度(空燃比でいる大量のパティキュレートが急激には燃えない程度の低い酸素濃度(空燃比でいる大量のパティキュレートが急激には燃えない程度の低い酸素濃度(空燃比でいる大量のパティキュレートが急激には燃えない程度の低い酸素濃度(空燃比で明明で上記のAよりはリッチ側の所定値B)に維持する時間(期間)が七2である。この時間七2は再生開始時のパティキュレート堆積量が大きくなるほど長くなる。

[0071]

また、再生処理開始時のパティキュレート堆積量が最大パティキュレート堆積量PMのX 以上では七2を一定としている。

[0072]

50

また、再生処理開始時のパティキュレート堆積量が所定値P以下の堆積量のときす2=0としている。これは、P以下のパティキュレート堆積量の場合には、中期を省略して後期に移行し、その総てを一気に燃焼させてもフィルタ41のペッド温度の上昇が少なく、フィルタ41のペッド温度が許容最高温度TMの×に達することはないので、中期の段階を省略して即座に後期へと移行させるためである。すなわち、所定値Pは、中期を介さずとも後期においてフィルタ41のペッド温度が許容最高温度を超えないパティキュレート堆

(10)

I 0 0 7 3 1

積量の最大量付近に設定している。

なお、図9において、機軸の再生処理開始時のパティキュレート堆積量は、再生処理開始 時のフィルタの圧力損失から図10を内容とするテープルを検索することにより演算すれ はよい。

10

[0074]

このようにして図りの再生フェーズの各段階の設定を総で終了したら図5に戻り、ステップ 8 では現在の処理タイミングが再生フェーズのいずれの段階にあるの外をみて、次のように各制御を行う。すなわち、前期であればステップ 4 に進み再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ペッド温度セTbed1へと制御する昇温制御を行う。

[0075]

中期であるときにはステップ 5、 7 に進み再生速度が目標再生速度へと小さくなるように 第1目標ペッド温度セTbed1を維持させる第1目標ペッド維持制御及び排気中の目標 酸素濃度を低濃度に設定した第1酸素濃度制御を行う。後期になるとステップ 6、 7 に進み再生速度が目標再生速度へと大きくなるように第1目標ペッド温度セTbed1より高い第2目標ペッド温度セTbed2を維持させる第2目標ペッド維持制御及び排気中の目標酸素濃度を高濃度に設定した第2酸素濃度制御を行う。

20

[0076]

ここで、図5のステップ4~8での制御をポスト噴射と酸素濃度制御に分けてさらに説明 する。

[0077]

[1] ポスト 噛射:

[1]-1. 昇温制御:

図 1 1 のフロー(図 5 ステップ 4 のサブルーチン)は昇温制御を行うためのものである。 【 0 0 7 8】

ステップ 8 1 ではクランク角センサ 8 8 により検出されるエンジン回転速度NE、メイン 燃料噴射量Q f 、温度センサ 8 7 により検出されるフィルタ入口温度 T 1 、温度センサ 8 8 により検出されるフィルタ出口温度 T 2 を読み込む。

[0079]

ステップ82ではフィルタ入口温度T1、フィルタ出口温度T2から前述の(2)式を用いてフィルタ41の実ペッド温度トTbe むを算出する。

[0080]

ステップ 8 8 では後段フラグ(ゼロに初期設定)をみる。ここでは後段フラグ= 0 であったとして説明すると、このとき前段の処理であるステップ 8 4 、 8 5 に進んでエンジン回転速度Ne とメイン燃料噴射量Qfとから図12、図18を内容とするマップを検索することにより前段ポスト噴射量1、前段ポスト噴射時期1を演算する。

40

[0081]

前段ポスト噴射1の機能は排気温度を触媒温度へと上昇させることが目的であるから、前段ポスト噴射量1は、基本的にメイン燃料噴射量のみによる排気温度(ペースの排気温度)と触媒活性温度の差に比例する値を与えればよい。つまり、触媒活性温度からの差が大きいほど大きな値の前段ポスト噴射量1を与える。ここで、ペースの排気温度は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど前段ポスト噴射量1を大きくしている(図12参照)。

[0082]

ステップ 8 6 ではフィルタ4 1 の実ペッド温度とTbedと触媒活性温度(240 ℃程度)を比較する。実ペッド温度とTbedが240 ℃未満であるときにはそのまま今回の処理を終了する。

(11)

[0083]

運転条件(Ne、Qf)に応じて前段ポスト噴射量1を与え続けるとやがて実ペッド温度 ドTbedが240℃以上になるので、このときにはステップ37に進んで後段フラグ= 1とする。

[0084]

この後段フラグ=1により次回よりはステップ33よりステップ38以降の後段での処理 に進む。

10

20

[0085]

ステップ 3 8 、 3 9 、 4 0 、 4 1 ではエンジン回転速度Ne とメイン燃料 噴射量Qfとから図1 4、図1 5、図1 6、図1 7を内容とするマップを検索することにより後段ポスト噴射量1、後段ポスト噴射時期1、基本後段ポスト噴射量2、後段ポスト噴射時期2を演算する。

[0086]

後段ポスト噴射量1は前段ポスト噴射量1と同様であり、ペースの排気温度と触媒活性温度の差に比例する値を与える。

[0087]

これに対して、ポスト噴射2の機能は触媒にHCを供給して燃焼させペット温度を第1目標ペット温度へと上昇させることが目的であるから、基本後段ポスト噴射量2としてはフィルタ入口温度T1と第1目標ペット温度もTbed1の差に比例する値を与える。つまり、第1目標ペット温度もTbed1からの差が大きいほど大きな値の基本後段ポスト噴射量2を与える。ここで、フィルタ入口温度T1は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど基本後段ポスト噴射量2を大きくしている(図16参照)。

[0088]

40

[0089]

上記の所定値Δ21は一定値でもよいし、実ペッド温度トTbedと第1目標ペッド温度 七Tbed1の差に比例させて与えてもかまわない。

[0090]

ステップ47ではこのようにして求めたフィードパック量FB21を基本後段ポスト噴射量2に加算した値を後段ポスト噴射量2として算出する。

[0091]

図示しなり燃料噴射制御フローでは、このように得られる前段ポスト噴射量 1、前段ポスト噴射時期 1 を用いて前段でのポスト噴射 (1 サイクル当たり 1 回のポスト噴射) か行われ、またこのように得られる後段ポスト噴射量 1、後段ポスト噴射時期 1、後段ポスト噴

射量 2 、後段ポスト噴射時期 2 を用いて後段でのポスト噴射(1 サイクル当たり 2 回のポスト噴射)が行われる。

(12)

[0092]

〔1〕 - 2. 第1目標ペッド温度への維持制御:

図18のフロー(図5ステップ6のサプルーチン)は第1目標ペッド温度もTbed1への維持制御を行うためのものである。

[0093]

10

[0094]

[0095]

ステップ $55\sim 5$ 8 はフィルタ4 1 の実ペッド温度 F T b e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d t e d e e d

20

[0096]

上記の所定値△1は一定値でもよいし、実ペッド温度とTbedと第1目標ペッド温度も Tbed1の差に比例させて与えてもかまわない。

[0097]

ステップ 6 0 ではこのようにして求めたフィードパック量FB1を基本ポスト噴射量1に 加算した値をポスト噴射量1として算出する。

[0098]

図示しなり燃料噴射制御フローでは、このように得られるポスト噴射量1、ポスト噴射時期1を用いて中期でのポスト噴射(1サイクル当たり1回のポスト噴射)が行われる。ここで、フィードパック量ドB1は負の値を採りするので、ポスト噴射量1はゼロになり得る(ステップ57、60)。このときには、フィルタ41内のパティキュレートが活発に燃焼して、ポスト噴射1により排気温度上昇制御を行う必要がないことを意味している。

40

[0099]

〔1〕 - 3. 第2目標ペッド温度への維持制御:

図21のフロー(図5ステップ8のサプルーチン)は第2目標ペッド温度セTbed2への維持制御を行うためのものである。

[0100]

(18)

よりポスト噴射量1、ポスト噴射時期1、基本ポスト噴射量2、ポスト噴射時期2を演算する。

[0101]

ポスト噴射量1は前期でのポスト噴射量(前段ボスト噴射量1、後段ポスト噴射量1)と同様であり、ペースの排気温度と触媒活性温度の差に比例する値を与える。中期でのポスト噴射量1との関係では、後期でのポスト噴射量1のほうが多くなり(図3最下段参照)、これによって排気温度が上昇しフィルタの再生速度が上昇する。

[0102]

基本ポスト噴射量 2 は、後段ポスト噴射量 2 と同様であり、フィルタ入口温度 T 1 と第 2 目標ペッド温度 t T b e d 2 の差に比例する値を与える。つまり、第 2 目標ペッド温度 t T b e d 2 からの差が大きいほど大きな値の基本ポスト噴射量 2 を与える。ここで、フィルタ入口温度 T 1 は低負荷低回転速度側のほうが低いので、これに対応して低負荷低回転速度側になるほど基本後段ト噴射量 2 を大きくしている(図 2 4 参照)。

[0 1 0 3]

ステップ 7 7 ~ 8 1 はフィルタ 4 1 の実ペッド温度 F T b e d が 第 2 目標ペッド温度 T T b e d 2 と 一 致するようにポスト 噛射量 2 のフィードバック量 F B 2 2 を 演算 する 部分である。 すなわち、ステップ 7 7 ではフィルタ 4 1 の実ペッド温度 F T b e d 2 等 2 目標ペッド温度 F T b e d 2 + ε)とを、またステップ 7 8 ではフィルタ 4 1 の実ペッド温度 F T b e d 2 - ε)とを 比較 する。

[0104]

ここで、後期で用いる第2目標ペッド温度もTbed2は、前期、中期で用いる第1目標ペッド温度もTbed1より高くしている。これは、再生処理の後期にはパティキュレートが燃焼しにくく(壁温で冷却されるため)、フィルタ41の再生速度を中期と同じに維持するためには目標ペッド温度を上げる必要があるためである。

[0105]

実ペッド温度ドTbedが第2目標ペッド温度上限値(七Tbed2+ ε)を超えているときにはステップ79に進んでフィードパック量(初期値はゼロ)FB22を所定値Δ22だけ減量し、これに対して実ペッド温度ドTbedが第2目標ペッド温度下限値(七Tbed2- ε)を下回っているときにはステップ80に進んでフィードパック量FB22を所定値Δ22だけ増量する。一方、実ペッド温度ドTbedが第2目標ペッド温度上限値と第2日標ペッド温度下限値との間に収まっているときにはステップ81に進んでフィードパック量FB22をそのまま維持する。

[0106]

上記の所定値△22は一定値でもよいし、実ペッド温度ドTbedと第2目標ペッド温度 七Tbed2の差に比例させて与えてもかまわない。

[0107]

ステップ82ではこのようにして求めたフィードパック量FB22を基本ポスト噴射量2 に加算した値をポスト噴射量2として算出する。

[0108]

図示しない燃料噴射制御フローでは、このように得られるポスト噴射量1、後段ト噴射時期1、ポスト噴射量2、ポスト噴射時期2を用いてポスト噴射(1サイクル当たり2回のポスト噴射)が行われる。

[0109]

〔2〕酸素濃度制御:

[2] -1、中期の酸素濃度制御(第1酸素濃度制御):

図26にパティキュレート堆積量(PM堆積量)が多い状態(つまり中期)で再生処理を行ったときのフィルタ入口温度、排気中酸素濃度とフィルタ41のペッド温度の最高温度との関係を示すと、パテキュレート堆積量が多いため曲線と曲線の間の間隔が短く、これは温度勾配が急であることを表している。

[0110]

50

20

JP 2004 183525 A 2004.7.2

(14)

このようにパティキュレート堆積量が多い状態では、 色酸素濃度側に目標酸素濃度の制御 範囲を設けることで、フィルタ41のペッド温度の許容最高温度内でフィルタ41の再生 処理を行うことができる。

[0111]

ここで、排気中の目標酸素濃度は空燃比に換算すると理論空燃比よりリーン側(例えば空気過剰率で1.5程度)である。パティキュレート堆積量が多い状態で高濃度の酸素があると、パティキュレートの燃焼速度が大きいためにフィルタ41に堆積しているパティキュレートが急激に燃えるので、これを抑えるため排気中の目標酸素濃度を低酸素濃度に設定している。

[0112]

また、目標酸素濃度の制御範囲に幅を設けているのは、パラツキと過渡時の制御遅れとを考慮したものである。

[0118]

[2] - 2. 後期の酸素濃度制御(第2酸素濃度制御):

図27には今度は、パティキュレート堆積量が少ない状態(つまり後期)で再生処理を行ったときのフィルタ入口温度、排気中酸素濃度とフィルタ41のペッド温度の最高温度との関係を示し、パティキュレート堆積量が少ない状態では曲線と曲線の間隔が広がり(温度勾配が緩やがとなり)、かつペッド温度の許容最高温度の位置も図26の場合より右方向に移動している。

[0114]

このため、パティキュレート堆積量が少ない状態では、排気中の酸素濃度を中期に比べ大きくしても、フィルタ41の再生処理中のペッド温度の最高温度を許容最高温度以下に保ってとができるので、後期には図中1)のように中期よりも目標酸素濃度を大きくする。これによって十分な酸素を供給してパティキュレートの燃焼速度を大きくし、フィルタ41に燃え残っているパティキュレートの総てを短期間で完全に燃え切らせることが可能となる。さらに、図中2)のようにフィルタ入口温度の目標値もT1をも上昇させることで、さらに再生処理時間の短縮とパティキュレートの再生効率の向上を図ることができる。

[0115]

【2】 - 8. 酸素濃度制御の制御結果: 図28に本実施形態による排気中酸素濃度の制御目標(目標酸素濃度)とその制御結果としての実際の排気中酸素濃度の変化を示す。図示のように中期に低酸素濃度に制御されていたものが、後期になると、それより高い酸素濃度へと切換えられている。なお、中期、後期を除く他の期間(前期を含む)では排気中酸素濃度が激しく変化している。これは、他の期間ではもともと排気中の酸素濃度制御を行っていないこと、また加速や減速が繰り返される過渡時のものであるからである。

[0116]

図28は排気中の目標酸素濃度を低濃度から高濃度へと単純に2段階に切換えるものであるが、図29のように、中期の後半部分で徐々に目標酸素濃度を大きくして後期の目標酸素濃度に滑らかにつなぐことにより、図28の場合より再生処理期間の短縮を図ることも可能である。

[0117]

[2] - 4、酸素濃度制御手段:

排気中の目標酸素濃度を七尺〇2 [%]、この目標酸素濃度七尺〇2が得られるときの空気過剰率を目標空気過剰率七入とすると、次式が成立する。

[0118]

 $t\lambda = 21/(21-tRO2)$ (3)

ただし、21:新気中の酸素濃度[%]、

なお、 (3) 式は燃焼による作動がスのモル増加を考慮していないが、 制御精度をさらに向上させる左めにこの効果を (3) 式に入れることもできる。

[0119]

50

40

JP 2004 183525 A 2004.7.2

(3)式の目標空気過剰率も入を得るための制御には吸入新気量の制御と、燃料噴射の制御とがある。

(15)

[0120]

[2] -4-1. 吸入新気量の制御:

(3) 式の目標空気過剰率七入を得るための吸入新気量を七Qのとすれば、燃料噴射量Q fとの間に次式が成立する。

[0121]

 $tQa = Qf \times 理論空燃比 \times t\lambda$ (4)

(3) 式を(4) 式に代入すると次式が得られる。

[0122]

tQa=Qa×理論空燃比×21/(21-tRO2) (5)

従って、(5)式の目標吸入新気量七Qのが得られるように吸入新気量を制御する。

[0123]

この場合、吸入新気量制御手段により、カパーできる運転領域が図30に示したように異なるので、吸入新気量制御手段に応じて次のように酸素濃度制御を行う。

[0124]

▲1▼吸入新気量制御手段が可変容量ターホ過給機21のとき:

R 6、 R 7、 R 8 の領域では可変容量ターボ過給機21により吸入新気量を制御する。例えば、可変ノズル24の開度を小さくするとターピン22の回転速度が高くなり、吸入新気量を増やす(酸素濃度を大きくする)ことができる。この逆に可変ノズル24の開度を大きくするとターピン22の回転速度が低くなり、吸入新気量を減らすことができる。

[0125]

▲2▼吸入新気量制御手段がEGR装置のとき:

R7、R8の領域ではEGR弁6(EGR装置)により吸入新気量を制御する。例えば、EGR率やEGR量を増加すれば吸入新気量を減らすことが、この逆にEGR率やEGR量を小さくすれば吸入新気量を増やすことができる。

[0126]

▲3▼吸入新気量制御手段が吸気絞り弁42(吸気絞り装置)のとき:

R8の領域では吸気絞り弁42により吸入新気量を制御する。例えば、吸気絞り弁42を閉じれば吸入新気量を減らすことが、この逆に吸気絞り弁42を戻せば吸入新気量を増や すことができる。

[0127]

[2] - 4 - 2. 燃料噴射の制御:

上記(5)式の目標空気過剰率七入を得るための目標燃料噴射量を七Qfとすれば、吸入新気量QaYの間に次式が成立する。

[0128]

 $Qa = \pm Qf \times 理論空燃此 \times \pm \lambda$ (6)

(8)式、(6)式を目標燃料噴射量もQFについて解くと次式が得られる。

[0129]

 $tQf = Qa \times (1/理論空燃比) \times (21-tRO2) / 21$ (7)

従って、(7)式の目標燃料噴射量tQFが得られるように燃料噴射を制御する。

[0180]

この場合、燃料噴射制御手段によりカパーできる運転領域が図31に示したように異なるので、燃料噴射制御手段に応じて次のように酸素濃度制御を行う。

[0131]

領域R9:メイン噴射時期を遅角しつつ(7)式の目標燃料噴射量tQFが得られるように燃料噴射を制御する。

[0132]

領域R10:メイン噴射時期の遅角とポスト噴射を行いっつ(7)式の目標燃料噴射量tQfが得られるように燃料噴射を制御する。ポスト噴射量を増加すれば燃料噴射量を増加

(16)

する (酸素濃度を小さくする) ことができる。ポスト噴射はエンジンの膨張行程で行うため、トルク増加をあまり伴わずに噴射量の増加を行うことができる。そしてトルク増加分はメイン噴射量を減少してコントロールする。

[0188]

領域R11:ポスト噴射と吸気絞りとメイン噴射時期とにより燃料噴射量を制御する。例えば吸気絞りを行うとポンピングロスが増加するため、これを補う分だけポスト噴射量を増加できる。また、このときのメイン噴射時期は噴射量を制御しない場合よりも進角側に制御する。

[0184]

〔2〕 - 4 - 8. 排気中酸素濃度のフィードパック制御:

10 ィー れる は実

上記の〔2〕 - 4 - 1、〔2〕 - 4 - 2での制御はオープンループ制御であるが、フィードパック制御を行わせることもできる。例えばエアフローメータ35出力より検出される実際の吸入新気量が上記(5)式の目標吸入新気量もQaと一致するように、あるいは実際の燃料喷射量が上記(7)式の目標燃料噴射量もQfと一致するようにフィードパック制御する。

[0135]

また、排気通路 2 に排気中の実際の酸素濃度を検出するセンサ(例えば広域空燃比センサ)を設けておき、このセンサにより検出される排気中の実際の酸素濃度が目標酸素濃度と 一致するようにフィードパック制御を行わせることもできる。

[0136]

20

ここで、本実施形態の作用を図るを参照しながら説明すると、同図は上から再生速度、フィルタのペッド温度、パティキュレート堆積量、ポスト噴射の期間及び時期、排気中の目標酸素濃度の動きをモデル的に示している。なお、第2段目においては本実施形態の場合を実線で、これに対して従来装置の場合を破線で示している。

[0187]

(1) 再生処理の前期:

前期には実ペッド温度ドTbedが触媒活性温度に達する前の前段で排気温度上昇を目的とするポスト噴射1のみを行い、実ペッド温度ドTbedが触媒活性温度に達した後の後段になると、HCの供給することを目的とするポスト噴射2を追加して、HCを活性状態にある触媒へと供給するので、触媒では酸化触媒反応による発熱が生じ、これによりペット温度が第1目標ペッド温度へと急速に上昇している。

80

[0138]

(2)再生処理の中期:

▲1▼フィルタのペッド温度がパティキュレートが自着火する温度である第1目標ペッド温度に維持した状態で、最下段のように排気中の目標酸素濃度を低濃度側に設定して、フィルタ41に堆積しているパティキュレートの燃焼速度を抑制するので、フィルタのペッド温度の最高温度が許容最高温度を上回ることがなく、これによりフィルタ41の耐久性が損なわれることがない。

【0189】

5 40

▲ 2 ▼排気温度を低下させることによりパティキュレートの燃焼速度を抑制する方法もあるが、この排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、排気やフィルタ41の熱慣性の影響を受けて制御の応答性が惡くなる。これに対して本実施形態では、こうした排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法でないた的排気やフィルタ41の熱慣性の影響を排除でき、制御応答性がよく制御の信頼性が高い。

[0140]

▲3▼排気温度によるパティキュレート燃焼速度制御方法だと、パティキュレートの燃焼速度を抑えようと排気温度を低下させたとき、これに伴ってフィルタ41のペッド温度が目標ペッド温度以下に低下するようだと再生不良が生じ得る。これに対して本実施形態では、第1目標ペッド温度を保ちつつ、パテキュレートの燃焼速度の抑制は酸素濃度制御で行うので、パテキュレートの燃焼中においても、フィルタ41のペッド温度が第1目標ペ

ッド温度を下回ることがない。すなわち、本実施形態は、排気温度によるパティキュレート 燃焼速度制御方法でないため、フィルタ41のペッド温度を第1目標ペッド温度より低下させる必要がなく、これによってフィルタ周辺の温度低下による再生不良を防止できる

(17)

[0141]

(3)再生処理の後期:

第1目標ペッド温度よりも高い第2目標ペッド温度に維持した状態で最下段のように排気中の目標酸素濃度を中期の段階より大きくすることで、再生処理の終了間近にフィルタ4 1に残存するパティキュレートの総でを迅速にかつ確実に燃え切らせることができ、これにより再生処理時間の短縮、ならびにほぼ完全なフィルタ再生を図ることができる。

10

[0142]

その結果、本実施形態では次の効果が得られる。

[0143]

(1)再生処理時間の短縮:

再生処理に要する燃料消費の増加を最小限とし、燃費惡化を抑制できる。再生処理中の高温維持時間が減少し、フィルタの熱劣化を抑制でき、排気性能の向上、寿命の延長が図れる。

[0144]

(2) 完全再生の実現:

た 20 テ

燃え残りのパティキュレートによる圧損上昇がなくなるので燃費惡化を防止できる。また、燃え残りパティキュレートの上に新たなパティキュレートが堆積して生じる不均一パティキュレート堆積は、局所的な急激なパティキュレート燃焼を引き起こし、その部分で耐久性が低下する可能性があるが、これを防止できる。

[0145]

実施形態では、再生処理の前期、中期、後期を時間で切り分ける場合で説明したが、これに限られるものでなく、中期、後期への移行判定には次のような方法がある。

[0146]

(の) 前期において中期への移行を判定する他の方法:実ペッド温度とTbedと第1目標ペッド温度せTbed1を比較し、実ペッド温度とTbedが第1目標ペッド温度せTbed1に到達すれば中期に移行する。

30

[0147]

(b) 中期において後期への移行を判定する他の方法:パティキュレートの燃焼がかなり進行して燃え尽きてくると、フィルタ入□温度T1よりフィルタ出□温度T2のほうが低くなる。従って、フィルタ出□温度T2が、フィルタ入□温度T1より所定値(例えば数+℃)を差し引いた値(つまりしきい値)を下回ったとき、後期に移行する。

[0148]

せて、図3第4段目からも分かるように後段ポスト噴射量とは多い。このため、図32下段に破線で示したように実ペッド温度ドTbe むが触媒活性温度(240℃)に達したタイミングでこの多い量の後段ポスト噴射量2をステップ的に与えると、パティキュレートの再燃焼中のペッド温度が異常に温度上昇する(図32上段の破線参照)。これは、実ペッド温度が触媒活性温度に達した時点でステップ的に変化する目標値(マップ値)を与れて後段ポスト噴射2を行うと、その噴射燃料が触媒上で気化潜熱を奪うために実ペッド温度の低下を招き、蒸発できない燃料が触媒上に残留する。そして、実ペッド温度が再び触媒活性温度まで上昇したときに、触媒上に残留するパティキュレートが急激に燃焼するためである。

,,

[0149]

これに対処するには、図82下段の実線で示したように目標値に対して応答遅れ処理を施した値で与えることが好ましい。このように、実ペッド温度が触媒活性温度付近にあるとまには目標値に対して応答遅れ処理を施した後段ポスト噴射量2を与えることで(請求項8に記載の発明)、後段ポスト噴射量2の蒸発によるペッド温度の低下を抑えることがで

20

30

40

JP 2004 183525 A 2004.7.2

(18)

き、触媒反応が開始するタイミングでのペッド温度の上昇を早めることができる。

[0150]

請求項2に記載の発明において、前期に昇温制御を行う手段は図5のステップ4及び図11、中期に第1目標ペッド温度維持制御を行う手段は図5のステップ6及び図18、中期に第1酸素濃度制御を行う手段は図5のステップ5、後期に第2目標ペッド温度維持制御を行う手段は図5のステップ8及び図21、後期に第2酸素濃度制御を行う手段は図5のステップ7によりされずれ果たされている。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施形態を示す概略構成図。
- 【図2】再生処理期間の3つの段階を示す特性図。
- 【図3】本実施形態の作用効果を説明するための波形図。
- 【図4】機能の異なるポスト噴射の使い分けを説明するための図。
- 【図5】再生処理の全体を説明するためのフローチャート。
- 【図6】再生処理フラグの設定を説明するためのフローチャート。
- 【図7】再生フェーズの設定を説明するためのフローチャート。
- 【図8】設定時間七1の特性図。
- 【図9】設定時間七2の特性図。
- 【図10】パティキュレート堆積量に対するフィルタ圧力損失の特性図。
- 【図11】昇温制御を説明するためのフローチャート。
- 【図12】前段ポスト噴射量1の特性図。
- 【図13】前段ポスト噴射時期1の特性図。
- 【図14】後段ポスト噴射量1の特性図。
- 【図15】後段ポスト噴射時期1の特性図。
- 【図16】基本後段ポスト噴射量2の特性図。
- 【図17】後段ポスト噴射時期2の特性図。
- 【図18】第1目標ペッド温度維持制御を説明するためのフローチャート。
- 【図19】ポスト喷射量1の特性図。
- 【図20】ポスト噴射時期1の特性図。
- 【図21】第2目標ペッド温度維持制御を説明するためのフローチャート。
- 【図22】ポスト噴射量1の特性図。
- 【図23】ポスト噴射時期1の特性図。
- 【図24】基本ポスト噴射量2の特性図。
- 【図25】ボスト噴射時期2の特性図。
- 【図26】 パティキュレート 堆積量が多い場合の再生処理時のペッド 温度の最高温度の特性図。
- ーニー 【図27】パティキュレート堆積量が少ない場合の再生処理時のペッド温度の最高温度の 特件図。
- 【図28】排気中の目標酸素濃度の設定方法を説明するための波形図。
- 【図29】他の実施形態の排気中の目標酸素濃度の設定方法を説明するための波形図。
- 【図30】吸入新気量制御手段を説明するための領域図。
- 【図31】燃料噌射制御手段を説明するための領域図。
- 【図32】後段ポスト噴射量2の変化波形図。

【符号の説明】

- 1 エンデン
- 2 排気通路
- 3 吸気通路
- 6 EGR弁
- 10 コモンレール式燃料噴射装置
- 17 ノズル(燃料噴射弁)
- 21 可変容量ターポ過給機

'n

8.1 エンジンコントローラ

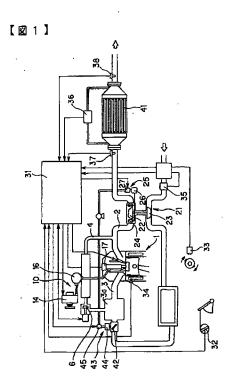
88 クランク角センサ

8.6 差圧センサ

37、38 温度センサ

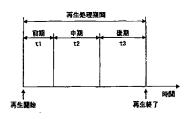
41 フィルタ

42 吸気絞り弁



[22]

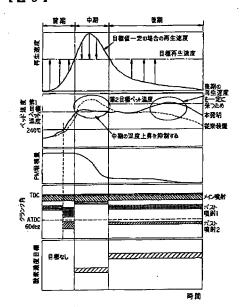
(19)

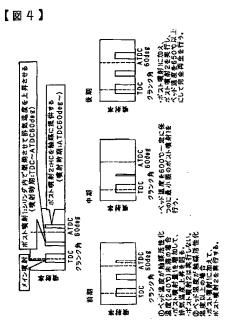


(20)

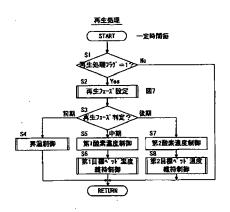
JP 2004 183525 A 2004.7.2

[23]

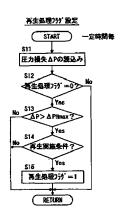




【図5】



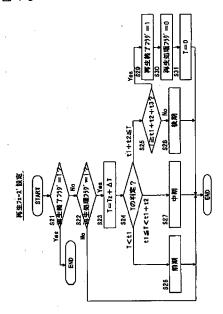
【図6】



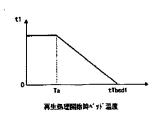
(21)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

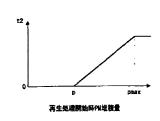
[27]



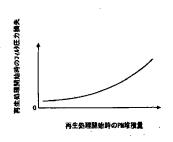
【图8】



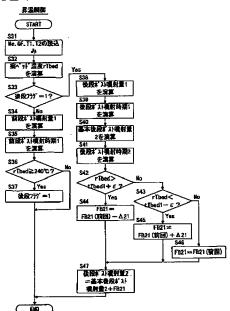
[29]



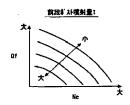
[図10]



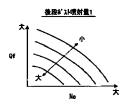
【図·1 1】



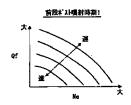
【図12】



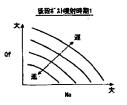
【図14】



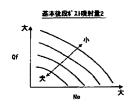
I 🖾 1 3 🕽



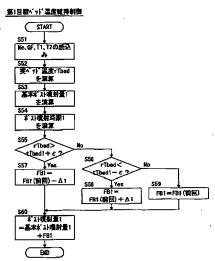
【図15】



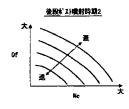
【図16】



【図18】



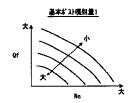
【図17】



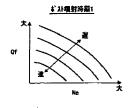
(23)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

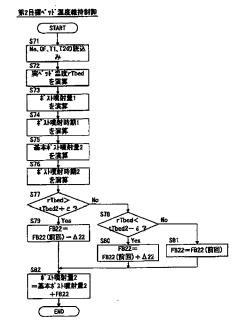
【図19】



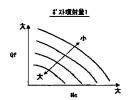
【図20】



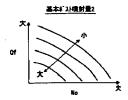
[221]



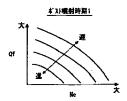
【図22】



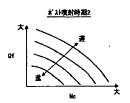
【図24】



[223]



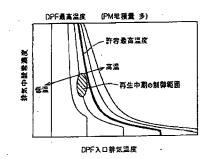
【図25】



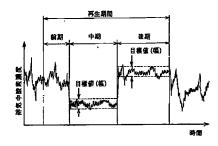
(24)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

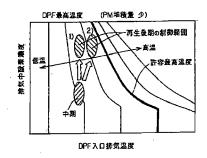
[226]



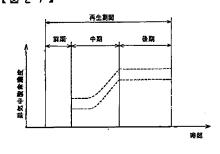
【图28】



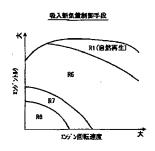
[27]



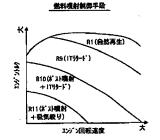
[2 2 9]



[280]



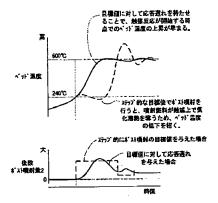
[2 3 1]



(25)

JP 2004 183525 A 2004.7.2

[232]



```
フロントページの続き
                                                           テーマコード(参考)
                             FΙ
(51) Int. Cl. 7
                                                           4D058
                                            ZABB
                               F01N 3/36
  F02D 41/04
                                             360A
                                F02D 41/04
  F02D 43/00
                                F02D 41/04
                                             380A
 F02D 45/00
                                F02D 41/04
                                             885A
// B01D 46/42
                                F02D 43/00
                                              301K
                                F02D 43/00
                                              301N
                                F02D 48/00
                                F02D 43/00
                                            301R
                                F02D 48/00
                                              3018
                                F02D 48/00
                                             301W
                                             312T
                                F02D 45/00
                                             314T
                                F02D 45/00
                                B01D 58/86
                                             103C
                                              B
                                B 0 1 D 46/42
(72)発明者 简本 直敬
         神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内
(72)発明者 大竹 真
         神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内
(72)発明者 田畑 宗広
         神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社内
ドターム(参考) 3G084 AA01 AA08 AA04 BA02 BA05 BA07 BA08 BA09 BA13 BA15
                BA20 BA24 DA10 DA22 DA27 DA37 EA11 EB01 EB11 EB22
                FAOO FAO7 FA10 FA18 FA20 FA26 FA27 FA29 FA88
           3G090 AA03 BA01 CA01 CA02 CA04 DA04 DA09 DA10 DA12 DA13
                DA14 DA18 DA20 EA05 EA06 EA07
           8G091 AA02 AA10 AA11 AA18 AA28 AB02 AB13 BA00 BA08 BA10
                BA15 BA31 BA38 CB02 CB03 CB07 CB08 DA01 DA02 DB10
                DCO1 EA01 EA08 EA05 EA07 EA08 EA16 EA17 EA80 EA82
                EA34 FB02 FB10 FB12 FB16 FC02 FC04 FC07 FC08 GA06
                HA14 HA36 HA37 HA42 HB05 HB06
            3G301 HA02 HA04 HA06 HA11 HA13 HA15 JA15 JA24 JA38 JB09
                LAO3 LB11 MAO1 MA11 MA18 MA23 MA26 NAO6 NAO7 NAO8
                NDO1 NEO1 NEO6 NE13 NE15 PAO1B PAO1X PBOSB PBOSX PDO2B
                PD02X PD11B PD11X PD14B PD14X PE01B PE01X PE03B PE03X PF03B
                PF03Z
            4D048 AA14 AB01 AB07 AC02 CC41 CC52 CC58 DA01 DA02 DA10
                DA13 DA20
            4D058 JA32 MA41 MA44 SA08
```